

けいはんな地域の研究機関、特に、中小・ベンチャー企業を積極的に支援します

支援件数

	支援件数	大学他	企業
24年度	34件	23件	11件
25年度	37件	22件	15件
26年度	47件	22件	25件
27年度	58件	36件	22件

利用形態と利用料金例

利用形態	利用区分	大学利用料	企業利用料
技術相談	一般利用	無料	無料
協力研究	四半期	27,000 円	54,000 円
技術代行/機器利用	1日利用	5,400 円	10,800 円

支援期間: 4月-12月、協力研究は4-6月、7-9月、10-12月の四半期単位、

主な支援機器



透過型電子顕微鏡 日本電子, JEM-3100FEF
 粉末X線回折装置 リガク, RINT-TTRIII/NM
 単結晶X線回折装置 リガク, ValiMax RAPID RA-Micro7
 X線散乱測定装置 リガク, Micro/Max-007HF
 多機能走査型X線光電子分光分析装置 アルバック・ファイ,
 PHI5000 Versa Probe II

MALDI-TOF質量分析装置 Bruker Daltonics, Autoflex II
 分光感度・内部量子効率測定装置 分光計器, CEP-2000RR
 大気中光電子分光装置 理研計器, AC-3
 熱電特性評価装置 カンタム・デザイン, PPMS EverCool II

支援試行機器 (下記の機器も適宜ご利用いただけます、詳細は連携マネージャーにご相談ください。)

電子線マクロアナライザ(EPMA) 島津, EPMA1610
 二次イオン質量分析(SIMS)装置 ULVAC-PHI, ADEPT-1010
 600MHz超伝導NMR JEOL, JNM-ECA600
 400MHz固体超伝導NMR JEOL, JNM-ECX400
 全自動元素分析装置 Perkin Elmer, 2400 II CHNS/O
 二重収束型質量分析計(EI, CI, FAB) JEOL, JMS-700
 ESI専用飛行時間型質量分析計(TOF-MS) JEOL, JMS-T100LC
 MALDI-Spiral-TOF質量分析装置 JEOL, JMS-S3000
 示差走査熱主計・示差熱熱主量同時測定装置
 日立ハイテクサイエンス DSC/TG-DTA 6200
 複合型表面組成分析装置(XPS/AES)島津, KRATOS AXIS-165

電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM) JEOL, JMS-7400F, JED-2200
 走査型プローブ顕微鏡(SPM) 日立ハイテクサイエンス,
 SPA400, SPI-3800N
 微細形状測定機 小坂研究所, ET200
 分光エリブソメーター HORIBA JOBIN YVON, UVISEL ER AGMS-NSD
 顕微レーザーラマン分光光度計 日本分光, NRS-4100-30
 円二色性分散計(CD) 日本分光, J-725
 フェムト秒, サブナノ秒パルスレーザー・蛍光寿命測定装置
 Coherent Mira, 宇翔KEC-160, 浜松ホトニクスC4780
 ダイナミック光散乱光度計 大塚電子, DLS-6000
 電子スピン共鳴(ESR)装置 JEOL, JES-FA100